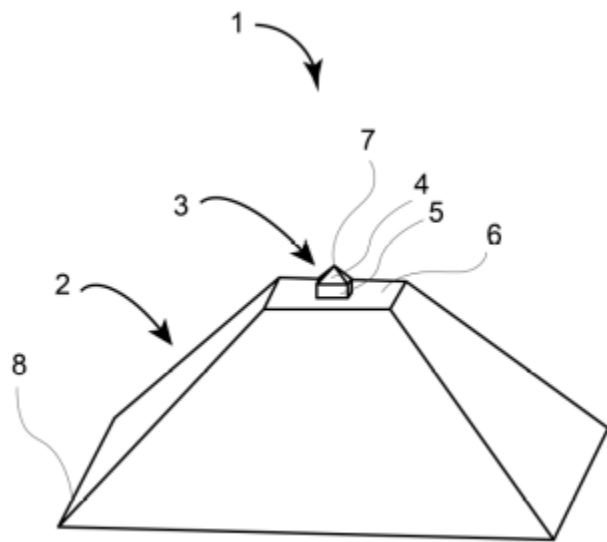


RESUMO DE TECNOLOGIA

CTIT-UFMG

ENGENHARIA

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica CTIT - UFMG



DISPOSITIVO METÁLICO PARA MICROSCOPIA POR VARREDURA POR SONDA E MÉTODO DE FABRICAÇÃO

Estágio de desenvolvimento: Avançado

Descrição

Dispositivo para aplicações em microscopia de varredura por sonda e um método de fabricação do mesmo. Mais precisamente é descrito um dispositivo fabricado por técnicas litográficas com reprodutibilidade para aplicação como uma sonda reprodutível de alta eficiência, tal como uma sonda de alta eficiência óptica.

Vantagens

- capaz de gerar um confinamento plasmônico conferindo a eficiência óptica desejada em microscopia por varredura de sonda
- dispositivo de alta qualidade
- possibilita o ajuste fino da faixa de energia de absorção óptica do dispositivo.

Inventor

Ado Jório de Vasconcelos / Bruno Santos de Oliveira / Thiago de Lourenço e Vasconcelos / Carlos Alberto Achete / Bráulio Soares Archanjo / Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado / Wagner Nunes Rodrigues

Titulares:

UFMG / INMETRO
Nº: BR1020150312032